光阴极 RF 腔中微波过程研究*

杨振萍1)* 李正红2)

1) 西南科技大学理学院 绵阳 621021)
 2) 中国工程物理研究院应用电子学研究所 绵阳 621900)
 (2007年5月29日收到2007年8月18日收到修改稿)

由于光阴极 RF 腔注入器中电子束的脉冲结构由激光控制的特点,根据其电子束脉冲结构的特点,利用微波腔的等效电路,给出了这种微波腔中微波场变化公式,和关于光阴极 RF 腔的最佳耦合计算公式,并以 CAEP 光阴极 RF 腔注入器为例进行理论分析,给出这些变化对电子束参数,如能散度,的影响.

关键词:光阴极 RF 腔注入器,光阴极,注入器,能散度 PACC:0200,4100

1.引 言

在自由电子激光(FEL)研究中,如何获得高质量的电子束是非常关键的技术^[1],它不仅要求电子束的品质好(流强高、发射度小、能散低等),而且要求电子束的平均功率高.目前光阴极 RF 腔注入器是获得这样高质量电子束的较好手段之一,同时由于光阴极 RF 腔注入器中电子束的脉冲结构由激光控制,造成光阴极 RF 腔中微波场建场过程同通常热阴极 RF 腔不同.

在光阴极 RF 腔微波建场的过程中,涉及到微 波源同 RF 腔的相互作用(耦合效应),束流与 RF 腔 的相互作用(束流负载效应),这两种作用既具有稳 态特性,又具有瞬态特性.对这两种相互作用有两种 分析方法,一种是等效电路法:将 RF 腔用一个等效 的集中参数谐振电路来模拟,比较简单;另一种是场 的本征模式分析法:根据谐振腔理论,将实际场按 RF 腔的本征模式展开,求得实际场的瞬态效应,较 复杂,能反映微波源同 RF 腔同束流与 RF 腔之间的 瞬态相互作用.然而在只考虑工作模式,忽略高阶模 式影响时,通常采用等效电路法.

2. 等效电路

在光阴极 RF 腔注入器中,当脉冲高功率微波

进入 RF 腔时,微波在 RF 腔中建立微波场,由于电 子束的脉冲结构由激光控制,束流随时间变化,是周 期性微脉冲结构(如图 1(a)).在微波场建立的起始 阶段,束流为0,当 RF 腔内微波场建立后,束流通过 RF 腔,微波场幅度略有降低,电子束通过后,束流为 0,微波场幅度略有回升(如图 1(b)).



图 1 光阴极 RF 腔中电子束和微波场随时间的变化 (a)电子 束脉冲结构 (b) RF 腔中微波场幅度随时间的变化

^{*} 国家自然科学基金(批准号:10347009)和国家高技术研究发展计划:批准号:863-803-403)资助的课题.

[†] 通讯联系人. E-mail:yzhenp@yahoo.com.cn

将整个加速结构(*n* + 0.5 腔)等效为一个谐振 腔,外部波导通过耦合窗向结构供电,其等效谐振电 路^[2,3]如图 (*x* a).

 波导
 耦合面
 谐振腔

 R
 R
 R

 K
 R
 R

 K
 K
 R

 K
 K
 K

 K
 K
 K

 K
 K
 K

 K
 K
 K

 K
 K
 K

 K
 K
 K

 K
 K
 K

 K
 K
 K



图 2 (a)波导与加速结构的耦合等效电路图 (b)波导与加速结 构之间的等效电路图

根据其等效原理,该等效电路可以进一步等效 (图 (b)),波导与谐振腔之间的耦合 M 相当于谐 振腔中串联一个负载电阻 RL.

3.RF 腔中加速场强的变化方程

由等效谐振电路可得,稳态时整个结构的阻 抗^[45]为

$$R_{\rm in} = R_0 + R_{\rm L} + j \frac{R_0 + R_{\rm L}}{Q} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) , \quad (1)$$

式中 *Q* 为整个结构(波导与加速结构)的品质因素 (加速腔的有载 *Q* 值)为

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R_0 + R_{\rm L}}.$$

加速腔的有载 Q 值可以表示为

$$Q = Q_0 / (1 + \beta_c), \qquad (2)$$

式中 Q_0 为加速结构的固有品质因素(即加速腔 值); $\beta_c = Q_0/Q_e$ 是外部供电波导与加速结构之间的 耦合系数,与耦合窗的大小和位置有关; Q_e 为外部 品质因素.

谐振时 腔的输入阻抗呈现纯电阻 ,其输入阻抗 为 $R_{in} = R_0$.

根据(1)式,谐振时微波腔的输入阻抗可以表 示为

$$\frac{R_{\rm in}}{R_{\rm L}} = \frac{Q_{\rm e}}{Q_0} = \beta_{\rm c} \,.$$

在场建立过程(无束负荷时),输入腔中的功率

满足
$$P_{\rm in} = \frac{\omega_0 W}{Q_0}$$
 ,则

$$\frac{R_{\rm L}}{R_{\rm in}} = \frac{Q_{\rm e}}{\omega_0 W} P_{\rm in} \,. \tag{3}$$

同时 在场建立过程中外部供电波导中的驻波 比 ρ 为

$$\rho = \frac{R_{\rm L}}{R_{\rm in}} = \frac{Q_0}{Q_{\rm e}}.$$

外部供电波导中的反射系数 Γ 为

$$\Gamma = \frac{1-\rho}{1+\rho}.$$

当源功率为 P₀ 时 则输入腔中的功率为

$$P_{\rm in} = 4P \frac{Q_0}{Q_e} / \left(1 + \frac{Q_0}{Q_e}\right)^2.$$
 (4)

由此可得 场建立过程 输入腔中的功率为

$$P_{\rm in} = \left(\frac{4P_0 \,\omega_0 \,W}{Q_{\rm e}}\right)^{1/2} - \frac{\omega_0 \,W}{Q_{\rm e}}.$$
 (5)

根据能量守恒定律,当存在束负荷时,输入腔的 功率为

$$P_{\rm in} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} + P_{\rm L} + P_{\rm b} , \qquad (6)$$

式中第一项用于增加腔中的储能,第二项是腔壁损耗,即 $P_{\rm L} = \frac{\omega_0 W}{Q_0}$,第三项是转移给束的功率(等于束的加速功率).则加速腔储能 W 变化的方程为

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} + \frac{\omega_0 W}{Q} = \left(\frac{4P_0 \omega_0 W}{Q_e}\right)^{1/2} + P_{\mathrm{b}}.$$
 (7)

由于 RF 腔中场强振幅 E 正比于储能 W ,则

$$E = \eta \sqrt{W} , \qquad (8)$$

式中 η 是联系腔内场强幅度与微波储能的系数.

利用(8)式,加速腔储能 W 变化的方程可改写 成加速腔加速场强变化的方程,即

$$2 \frac{dE}{dt} + \frac{\omega_0 E}{Q} = \eta \left(\frac{4P_0 \omega_0}{Q_e}\right)^{1/2} + \frac{\eta^2}{E} P_b.$$
 (9)

令 $E_0 = \eta \left(\frac{4P_0 \omega_0}{Q_e}\right)^{1/2} \frac{Q}{\omega_0}$, $t_f = \frac{2Q}{\omega_0}$,则加速腔加速

场强变化的方程可以写为

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} + \frac{E}{t_{\rm f}} = \frac{E_0}{t_{\rm f}} + \frac{\eta^2}{2E} P_{\rm b}. \qquad (10)$$

4.1.微波建场过程

在建场阶段, 束流为0, 束流功率也为0,则

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} + \frac{E}{t_{\mathrm{f}}} = \frac{E_{\mathrm{0}}}{t_{\mathrm{f}}}.$$

由此可得建场阶段 腔内场强幅度的变化为

$$E = E_0 \left(1 - \exp\left(- \frac{t}{t_f} \right) \right) , \qquad (11)$$

式中 $E_0 = \eta \left(\frac{4P_0 \omega_0}{Q_e}\right)^{1/2} \frac{Q}{\omega_0}$ 为稳态时腔内微波的场强 幅度 $_{t_f} = \frac{2Q}{\omega_0}$ 为微波场的建场时间常数.

4.2. 电子束同 RF 腔的相互作用

当电子束通过 RF 腔时,电子的能量增益正比于 RF 腔中微波的场强幅度 *E*,可以表示为

$$\Delta \gamma = \frac{eE}{2m_0 c^2} f(\varphi), \qquad (12)$$

式中 φ 为出口处电子相位 ,则电子束通过时获得的 能量为

$$\Delta W = \frac{qE}{2} f(\varphi).$$

电子束同微波作用时间等于电子束通过 RF 腔的时间 ,即 $t = \frac{l}{c} (l 为加速结构长度).$

则电子束通过 RF 腔时,电子束从微波场获得的功率可近似为

$$P_{\rm b} \approx \frac{c}{2l} q E f(\varphi).$$
 (13)

由此可得,电子束通过 RF 腔时加速腔加速场 强变化的方程为

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} + \frac{E}{t_{\rm f}} = \frac{E_0}{t_{\rm f}} - \frac{\eta^2}{4l} q c f(\varphi). \qquad (14)$$

由此可得电子束通过 RF 腔后 ,加速腔加速场 强为

$$E_{1} = \left(E_{0} - \frac{\eta^{2}}{4} t_{f} qcf(\varphi) \right) (1 - e^{-\frac{t}{t_{f}}}) + E e^{-\frac{t}{t_{f}}}.$$
 (15)

电子束通过 RF 腔的时间很短 ,由上式可得电 子束通过 RF 腔后 ,微波场幅度降低 ,即

$$\Delta E = \frac{\eta^2}{4} q f(\varphi) - \left(\frac{l}{ct_f}\right) E_0. \qquad (16)$$

由于电子束通过 RF 腔的时间很短,微波腔加速场强降低 ΔE 可以进一步近似为

$$\Delta E = \frac{\eta^2}{4} q f(\varphi). \qquad (17)$$

由(17)式可以看出,电子束通过微波腔加速场 强的降低与初始状态(即微波腔的储能)无关.

 $当 △ E \ll E$ 时 ,微波腔储能降低为

$$\Delta W = \frac{2}{\eta^2} E \Delta E = \frac{1}{2} q E f(\varphi), \qquad (18)$$

式中 $\eta^2 = \frac{E^2}{W}$ 同微波腔结构有关.

4.3. 电子束通过后 RF 腔加速场强的变化

在电子束通过后,束流为0,束流功率也为0,其 方程为

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} + \frac{E}{t_{\mathrm{f}}} = \frac{E_{\mathrm{0}}}{t_{\mathrm{f}}}.$$

由此可得电子束通过后在下一个电子束达到 前 ,RF 腔内场强为

 $E_2 = E_0(1 - e^{-\frac{T-t}{t_f}}) + E_1 e^{-\frac{T-t}{t_f}}$, (19) 式中 E_1 为电子束通过 RF 腔后微波场强幅度, T 是 电子束之间的时间间隔.

4.4.电子束能量

在光阴极 RF 腔注入器⁶⁷¹中,驱动激光器以脉 冲串的形式工作,一个宏脉冲中有很多个微脉冲,微 脉冲间隔 T.根据上面的推导,当一个宏脉冲电子束 串通过 RF 腔时,每个电子束通过 RF 腔时腔内场强 E有一定变化,在电子束串通过时,腔内场强 E有 一个稳态值,其稳态值由 $E = E_2$,决定,则

$$E = E_0 (1 - e^{-\frac{T-t}{t_f}}) + \left(\left(E_0 - \frac{\eta^2}{4l} t_f qc f(\varphi) \right) (1 - e^{-\frac{t}{t_f}}) + E e^{-\frac{t}{t_f}} \right) e^{-\frac{T-t}{t_f}}$$

$$= \left(E_0 - \frac{\eta^2}{4l} t_f qc f(\varphi) \left(e^{\frac{t}{t_f}} - 1 \right) / e^{\frac{T}{t_f}} \right).$$
 (20)

由于微波建场时间远大于束流脉冲间隔,因而 可以近似为

$$E \approx \left(E_0 - \frac{\eta^2}{4} q \left(\varphi \right) \frac{t_f}{T} \right).$$
 (21)

则稳态时,电子通过加速腔的能量增益近似为

$$\Delta \gamma = \frac{eEf(\varphi)}{2}.$$

因此电子束串通过 RF 腔后,获得的能量可近 似为

$$W = n \frac{q E f(\varphi)}{2}$$

$$\approx \frac{n q f(\varphi)}{L_0} \left(E_0 - \frac{\eta^2}{4} q f(\varphi) \frac{t_f}{T} \right). \quad (22)$$

由于 $E_0 = \eta \left(\frac{4P_0\omega_0}{Q_e}\right)^{1/2} \frac{Q}{\omega_0}$, $t_f = \frac{2Q}{\omega_0}$ 则电子的能

量可以写为

对耦合系数 β_c 求导 ,由 $\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}\beta_c}$ = 0 ,可以求得最佳 耦合系数 β_c ,则最佳耦合系数为

$$\beta_{c} = 1 + \frac{\eta^{2} q^{2} f^{2}(\varphi)}{4T^{2}} \frac{Q_{0}}{\omega_{0} P_{0}} + \frac{\eta q f(\varphi)}{4T} \sqrt{\frac{Q_{0}}{\omega_{0} P_{0}}} \\ \times \sqrt{1 + \frac{\eta^{2} q^{2} f^{2}(\varphi)}{32T^{2}} \frac{Q_{0}}{\omega_{0} P_{0}}}. \quad (24)$$

由(24)式可以看出光阴极 RF 腔与波导之间的 最佳耦合系数不仅同电子束(束流负载)有关,而且 同微波功率源功率、RF 腔的品质因子 Q 和电子束 的加速相位有关.

5.CAEP 光阴极 RF 腔注入器

5.1. CAEP 光阴极 RF 腔

CAEP 光阴极 RF 腔^[8,9]是 *L* 波段(2.5)腔,首腔 为半腔,RF 腔的参数如表 1,轴向加速电场场分布 近似为

$$E_{z}(z) = 40.82 E(\cos kz + 0.0175\cos 3kz)$$
 (首腔),

$$E_z(z) = 21.98 E(\cos kz - 0.0175\cos 3kz)(E^2),$$

 $E_z(z) = 15.7E(\cos kz - 0.202\cos 3kz)$ (腔 3).

当电子束通过 RF 腔时,由于阴极表面场强很高,电子运动速度可以近似为光速,只考虑基波场的作用,忽略空间高次谐波项,同时忽略电子束的横向运动,根据轴向加速电场场分布,电子的能量增益为

$$\Delta \gamma = \frac{eE}{2m_0 c^2} f(\varphi) l , \qquad (25)$$

式中 φ 为出口处电子相位,

$$f(\varphi) = 58.2l\sin\varphi + \frac{40.82}{k}\cos\varphi ,$$

其中 l=0.115m(l 为 RF 腔的腔长).

表 1 CAEP 光阴极 RF 腔的参数

RF 腔	首腔	腔 2	腔 3
频率/MHz	1299.8	1299.8	1299.3
品质因子 Q/104	1.671	2.3506	2.2417
渡越时间因子 T	0.79	0.79	0.842
分流阻抗 Ζ(MΩ/m)	54.1	76.1	83.1
腔内场强幅度 E = 1(MV/m)时			
RF 腔中储能/J	1.487	0.862	0.380
RF 腔中腔壁损耗/MW	0.718	0.296	0.138
轴向平均电场/(MV/m)	26	14	10

由此 根据表 1 光阴极 RF 腔的参数,当腔内场 强幅度 E = 1(MV/m)时,RF 腔中储能为 2.73 J,腔 壁损耗为 1.15 MW,加速结构的品质因子为 Q = 1.94×10⁴,腔内场强幅度 E 与储能的系数为 $\eta =$ 0.605.

5.2. CAEP 光阴极 RF 腔中微波场的数值计算

在 CAEP 光阴极 RF 腔注入器中,驱动激光器以 脉冲串的形式工作,一个宏脉冲中有 812 个微脉冲, 微脉冲间隔为 12.5 ns,由(24)式可得,RF 腔与波导 之间的最佳耦合系数 $\beta_{e} = 1.5$,采用的微波功率源 是 KL-28 速调管,其峰值功率为 3.5 MW,RF 腔腔壁 允许的极限场强大于 56 MV/m.

图 3 为波导中微波功率为 1.15 MW ,RF 腔与波 导之间的耦合系数为 1.5 时,RF 腔中的微波建场 过程.



图 3 CAEP 光阴极 RF 腔中的微波建场过程

图4为波导中微波功率为1.15MW,电子束的



图 4 (a)RF 腔中微波场随时间的变化 (b) 电子能量随时间的 变化



图 5 不同耦合时 ,RF 腔时微波场随时间的变化 (a) $\beta_c = 1.0$; (b) $\beta_c = 2.0$

电荷为 1nC 时,电子束通过 RF 腔时微波场随时间的变化和微脉冲电子束电子能量随时间的变化.

图 5 为波导中微波功率为 1.15 MW,不同耦合 系数,电子束的电荷为 1nC 时,电子束通过 RF 腔时 微波场随时间的变化.

图 6 为波导中微波功率为 1.15 MW,不同耦合 系数,电子束的电荷为 1nC 时,不同时间微脉冲电子 束能量随时间的变化.



图 6 不同耦合时 电子能量随时间的变化 (a) $\beta_c = 1.0$ (b) $\beta_c = 2.0$

6.结 论

在光阴极 RF 腔注入器中,尽管电子束的微脉 冲束团的电荷较大,峰值流强较高,但是由于电子束 微脉冲结构的站空比较大,其平均流强较低,其负载 效应也较低,在微波腔的耦合设计时,其最佳耦合度 较为接近1.通过比较图6中不同耦合系数时,电子 束的能量变化,即使耦合度为1时,由于负载效应使 得微波腔中微波场变化而引起的电子束微脉冲之间 的脉间能散也很小,而且耦合度越接近1,电子能量 增益越大.

- [1] Li Z H, Chang A B, Ju B Q 2007 Acta Phys. Sin. 56 2603(in Chinese] 李正红、常安碧、鞠炳全 2007 物理学报 56 2603]
- [2] Li Z H, Hu K S, Zhang H 2002 *High Power Laser and Particle Beam* 13 99(in Chinese] 李正红、胡克松、张红 2002 强激光与 粒子束 13 99]
- [3] LiZH, MengFB, HuKS 2004 Acta Phy. Sin. 53 3627 (in Chinese]李正红、孟凡宝、胡克松 2004 物理学报 53 3627]
- [4] Li Z H, Huang H, Meng F B 2005 Acta Phys. Sin. 54 1564(in Chinese]李正红、黄华、孟凡宝 2005 物理学报 54 1564]
- [5] Huang H, Fan Z K, Tan J 2004 Acta Phy Sin. 53 1129 (in Chinese] 黃 华、范植开、谭 杰 2004 物理学报 53 1129]

- [6] Zhu M, Wu H S 1987 Acta Electronics 4 8(in Chinese] 朱 敏、吴 鸿适 1987 电子学报 4 8]
- [7] Wang S H, Luo Z H, Luo Y X 1980 Principle of Linac for Proton (Beijing: Atomic Energy Press) p143 (in Chinese] 王书鸿、罗紫 华、罗应雄 1980 质子直线加速器原理(北京 原子能出版社) 第 143 页]
- [8] Wu H S 1986 Principle of Micreowave Electronics (Beijing: Science Press)p250(in Chinese]吴宏适 1986 微波电子学原理(北京 科学出版社)第 250页]
- [9] Li Z H 2000 Ph.D. Thesis, (Mianyang: CAEP) in Chinese) [李 正红 2000 博士论文(绵阳:中国工程物理研究院研究生部)]

Microwave processes in a RF photoinjector*

Yang Zhen-Ping¹[†] Li Zheng-Hong²

1) Science College, South-western University of Science and Technology, Mianyang 621021, China)

2 X Institute of Applied Electronics , China Academic Engineering Physics , Mianyang 621900 , China)

(Received 29 May 2007; revised manuscript received 18 August 2007)

Abstract

The equivalent-circuit method is adopted to study microwave processes in an RF photoinjector , and the optimized coupling between the input mcirowave system and the RF cavity is theoretically obtained based on the micro-pulse properties of the RF photoinjector. A CAEP RF photoinjector is theoretically analyzed , and the electron beam energy spread of micro-pulses induced by beam load is also investigated.

Keywords : RF photoinjcteor , photocathode , injector , energy spread **PACC** : 0200 , 4100

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10347009) and the National High Technology Project (Grant No. 863-803-403).

[†] Corresponding author. E-mail : yzhenp@yahoo.com.cn